

METROLOGICKÁ LABORATOŘ

Špičková měřicí technologie a odborná preciznost – klíč k výrobě ultrapřesné optiky.
Díky pokročilým měřicím systémům a rozsáhlému know-how našich specialistů dokážeme kontrolovat každý detail optických prvků s extrémní přesností.



ASI QED – Aspheric Stitching Interferometer

měření elementů s vysokou numerickou aperturou (např. hemisféry) a asférických elementů s odchylkou od ideální sféry až 650 μm

LuphoScan

měření rotačně symetrických sférických i asférických povrchů s průměrem až 250 mm a s nejistotou měření < 50 nm PV

NewView 7200

koherenční skenovací interferometrie umožňující bezkontaktní měření topografie povrchů s komplexními tvary a z různých materiálů se subnanometrovým axiálním rozlišením

AFM Mikroskop

mikroskop atomárních sil pro vizualizaci a měření topografie povrchu s vysokým laterálním (až 30 nm) i vertikálním (0,1 nm) rozlišením

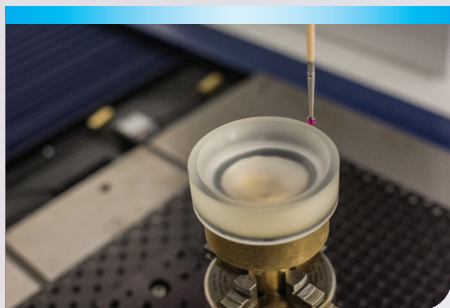
LSM Mikroskop

konfokální mikroskop pro měření topografie povrchu s axiálním rozlišením 1 nm pro určování mikrodrsnosti, zvlnění, tloušťky vrstev,...

SpectroMaster

refraktometrie prismatických elementů s vysokou přesností a s možností práce ve VIS a NIR oblasti

ROVINNÉ, SFÉRICKÉ A ASFÉRICKÉ INTERFEROMETRY |
 KOLIMÁTORY, AUTOKOLIMÁTORY | GONIOMETRY (VČETNĚ RTG GONIOMETRU) |
 3D SOUŘADNICOVÉ MĚŘENÍ | SPEKTROMETRY | INTERFEROMETRY V BÍLÉM SVĚTLE |
 KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP, AFM MIKROSKOP | REFRAKTOMETRY | SFÉROMETRY |
 TLOUŠŤKOMĚRY | DÉLKOVÉ KOMPARÁTORY | RONCHIHO A FOUCALTOVY TESTY



Mitutoyo LEGEX 774

měření tvarů optických i mechanických komponent s přesností $[0,35+0,1L/100]$ μm v rozsahu měření 700 x 700 x 400 mm

MarForm MFU 200 Aspheric 3D

měření topografie rovinných, sférických, asférických a freeform optických komponent až do průměru 200 mm s přesností lepší než 50 nm PV



DynaFiz interferometer

4" dynamický laserový interferometr pro velmi přesné měření a justáž v reálném čase a v přítomnosti vibrací

VÝVOJ VLASTNÍCH MĚŘIDEL A MĚŘICÍCH TECHNIK

- asférický interferometr fungující na principu multivlnné absolutní interferometrie
- interferometr pro měření planoparalelních elementů bez vícenásobné interference
- soustava pro vizualizaci svářečského procesu
- digitální holografické měřicí metody a mikroskopie
- metoda pro měření homogenity optických materiálů
- senzory pro měření vlnoplochy
- hyperspektrální detekční systém
- okamžité hyperspektrální zobrazování využívající komprimovaného snímání